

令和6年度 応用コース:手引き・基礎コース受講済みの方を対象とした電顕のステップアップコース

Advanced course: Step-up course of electron microscopy for those who have already taken the guide and basic course 【The following

(時間:受講時間は各コースによって異なります。 The length of time takes depends on each course.)

開催月 Month	コース Training course	使用予定装置 Using the device	実施日 Date	申込締切日 定員になり次第 受付終了します
5月 May	走査透過電顕法(STEM) ^{※1} Scanning-Transmission Electron microscopy	収差補正電顕(ARM-200F) Cs-corrected EM	講義: 5/20(月)10:00-12:00 実習: 5/21(火) or 22(水) 10:00-16:00	締め切り
	超高压電子顕微鏡 High Voltage TEM	超高压電顕 HVEM	講義: 5/23(木)10:00-12:00 実習: 5/24(金) 10:00-15:30	締め切り
6月 Jun.	分析TEM法 ^{※2} Analysis Electron Microscopy	収差補正電顕(ARM-200F) Cs-corrected EM	講義: 6/17(月)10:00-12:00 実習: 6/18(火) or 19(水) 10:00-17:00	締め切り
7月 Jul.	電子回折とその解析 Electron Diffraction and the Analysis	JEM-2100HC	講義: 7/29(月)10:00-15:00 実習: 7/30(火) 10:00-15:30	締め切り
8月 Aug.	分析SEM法 Analysis Scanning Electron Microscopy	SEM (Ultra55)	講義: 8/22(木)10:00-17:00 実習: 8/23(金) 10:00-15:30	締め切り
9月 Sep.	高分解能電顕法 ^{※2} High Resolution Electron microscopy	収差補正電顕(ARM-200F) Cs-corrected EM	講義: 9/24(火)10:00-16:00 実習: 9/25(水) or 9/26(木)10:00-16:00	締め切り
10月 Oct.	FIBによる試料作製法 ^{※3} Sample preparation using FIB	FIB-SEM (Quanta)	講義: 10/15(火)10:00-17:00(デモ含む) 実習: 10/17(木) or 18(金) 10:00-17:00	締め切り
	走査透過電顕法(STEM) ^{※1} Scanning-Transmission Electron microscopy (STEM)	収差補正電顕(ARM-200F) Cs-corrected EM	講義: 10/21(月)10:00-12:00 実習: 10/23(水) or 24(木) 10:00-16:00	締め切り

※1. 5月と10月のSTEMは同じ内容です。

"Scanning-Transmission Electron microscopy (STEM)" in May and October are the same in content.

※2. 「分析TEM法」、「高分解能法」受講希望の方は、先に「STEM」を受講してください。

If you want to take "Analysis Electron Microscopy" and "High Resolution Electron microscopy", please take "STEM" in advance.

※2. 講義の際にシミュレーション演習を行います。各自ノートPCを持参ください。